JAEA-Research 2011-050



低雑音増幅器と雑音性能 (委託研究)

A Low Noise Amplifier and Its Noise Performances (Contract Research)

> 山岸 秀志 藤 健太郎 Hideshi YAMAGISHI and Kentaro TOH

J-PARC センター 物質・生命科学ディビジョン

Materials and Life Science Division J-PARC Center

K PS È

ency 日本原子力研究開発機構

October 2012

Japan Atomic Energy Agency

本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。 なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(<u>http://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。

独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究技術情報部 研究技術情報課
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4
電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to Intellectual Resources Section, Intellectual Resources Department, Japan Atomic Energy Agency 2-4 Shirakata Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2012

低雑音増幅器と雑音性能

(委託研究)

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 物質・生命科学ディビジョン 山岸 秀志^{*}、 藤 健太郎

(2011年 12月14日受理)

高速、高位置分解能二次元ガス中性子検出器システムを実現するには、高速低雑音 ASIC が必要である。高速低雑音 ASIC を開発するため、これに必要な高い gm で低雑音の p-MOSFET、MP8 と MP16 を提案した。本稿では簡単な低雑音増幅器(LNA)を提案し、LNA におけるノイズパワーと雑音指数(NF)の計算法を示した。また、LNA に MP8 及び MP16 を適用して NF を計算評価し、これらの p-MOSFET が高速低雑音 ASIC 用として十分な性能を有していることを確認した。

本報告書は日本原子力研究開発機構が日本アドバンストテクノロジー株式会社との業務委託契約により実施した研究成果に関するものである。 J-PARC センター:〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 ※派遣社員(日本アドバンストテクノロジー株式会社)

JAEA-Research 2011-050

A Low Noise Amplifier and Its Noise Performances (Contract Research)

Hideshi YAMAGISHI** and Kentaro TOH

Materials and Life Science Division, J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received December 14, 2011)

For development of two-dimensional position sensitive (2-D) neutron detectors with fast response and high spatial resolution, an ASIC with fast response and low noise performances is required. The MP8 and MP16, consisting of p-MOSFETs, with high g_m and low noise have been proposed to develop the ASIC. In this paper a simple low noise amplifier (LNA) was designed and the noise power and the noise figure were analytically calculated. The results were also applied to LNAs using MP8 or MP16 configuration. The results showed that the MP8 and MP16 had enough performances for the ASIC.

Keywords: MOSFET, CMOS, ASIC, Neutron Detector, Neutron Two-dimensional Position Detectors, Nuclear Electronics, Neutron Imaging, Neutron Scattering

This work was performed by Japan Atomic Energy Agency under contract with Japan Advanced Technology Co..

*Attached Staff(from Japan Advanced Technology Co.)

1. 序論	1
2. p-MOSFET を用いた低雑音増幅器 (LNA)	2
2.1 LNA の構成	2
2.2 LNA の入力インピーダンス	2
2.3 LNA の雑音源を含めた等価回路	3
2.4 雑音指数 (Noise Figure, NF)	4
3. LNA におけるノイズパワースペクトル密度(S _o)	5
3.1 LNA における入力ゲート回路パラメータ	5
3.2 信号源抵抗による S _o	5
3.3 DS 間抵抗雑音電流による S _o	6
3.4 ゲート誘起雑音(Induced gate noise)	6
3.5 DS 間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合 S _o	7
3.6 フリッカー雑音による S _o	8
3.7 ゲート抵抗及び Lg抵抗雑音による So	9
3.8 LNA の雑音指数(NF)	9
4. LNA の特性1	11
4.1 雑音指数評価に必要な MOSFET のパラメータ1	11
4.2 雑音指数評価1	13
5. 結論1	15
謝 辞1	15
参考文献1	16

Contents

1	Introduction	1
2	A low noise amplifier (LNA) with p-MOSFETs	2
	2.1 The construction of LNA	2
	2.2 Input impedance in LNA	2
	2.3 The equivalent circuit with noise sources for LNA	3
	2.4 Noise figure (NF)	4
3	Noise power spectral density (So) in LNA	5
	3.1 Circuit parameters at the gate in LNA	5
	3.2 S _o due to signal source resistance	5
	3.3 S _o due to channel thermal noise	6
	3.4 Induced gate noise	6
	3.5 S _o due to total noise consisted channel thermal noise and induced gate noise	7
	3.6 S _o due to flicker noise	8
	3.7 S _o due to induced gate resistance and L _g resistance noises	9
	3.8 NF for LNA	9
4	Noise performances of LNA	11
	4.1 Parameters in MOSFET for estimation of NF	11
	4.2 Evaluation of NF	13
5	Conclusion	• 15
A	cknowledgment	15
R	eferences	16

図リスト

Fig.2.1. A LNA circuit with p-MOSFETs	2
Fig.2.2. Equivalent circuit of the LNA for calculation of input impedance Z _i	2
Fig.2.3. Equivalent circuit of the LNA for input stage noise calculations	3
Fig.4.1. Schematic diagram of MP8 with high g _m consisted of 16 p-MOSFETs	11
Fig.4.2. Schematic diagram of MP16 with high g _m consisted of 32 p-MOSFETs	11
Fig.4.3. Zero-bias drain conductance, g_{d0} , of MP1, MP8 and MP16 as a function of V_{gs}	11
Fig.4.4. Transconductance, g_m , of MP1, MP8 and MP16 as a function of V_{gs}	11
Fig.4.5. Noise power ratios of MP8 compared with each noise source.	12
Fig.4.6. G _m characteristics of the LNA compared with MP1, MP8 and MP16.	12
Fig.4.7. NF characteristics of the LNA as a function of the resonance frequency	13
Fig.4.8. NF characteristics of the LNA as a function of V_{gs} .	14

Table 4.1. Parameters of p-MOSFETs at the condition as same drain current density. ------ 13

This is a blank page.

1. 序 論

高速・高位置分解能二次元ガス型中性子検出器用の多チャンネル高速微小信号計測システムを 実現するには、高速微小信号増幅器、パルス整形回路、パルス波高弁別回路及び LVDS(Low Voltage differential signaling) 出力回路から構成される信号処理チャンネルを 10mm 角の Si チップ上に数 10 チャンネル以上を組み込める ASIC (Application Specific Integrated Circuit) の開発が不可欠であ る。二次元ガス型中性子検出器からの出力パルスが 100fC 以下と極めて小さいため、ASIC に組 み込まれる高速微小信号増幅器には低雑音の増幅器が必要である。

高機能低雑音 ASIC の製作には Si-MOSFET(Silicon-type Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)を用いる必要があるが、MOSFET は作動原理上、バイポーラ・トランジスタと比較して、速度が遅く雑音が大きい、その上、変換コンダクタンス g_m (信号増幅度)が mS オーダで小さい等の大きな欠点がある。特にフリッカー雑音、別名 1/f と呼ばれる低周波雑音はバイポーラ・トランジスタと比較して1 桁程度大きい等、数多くの課題がある。

しかし、MOSFET はゲートが酸化皮膜により DS チャンネル間と絶縁されているため、入力バ イアス電流が 1pA 程度であり殆ど必要としない。このため低消費電力である。ゲート回路にキャ パシタンスを持ち回路内にキャパシタンスを容易に作ることができ、デジタル回路を構成するの に優位である。近年、携帯電話等の普及によって高密度、高速且つ低消費電力の集積回路の要求 が高まり、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)の微細加工技術が飛躍的に進んだ。 また、多機能のアナログとデジタル回路を1チップ化したモノリシック集積回路 ASIC の需要も 高まり、アナログ回路を CMOS で製造する技術も進歩した。速度が遅い課題については、電極間 距離を数 100nm 以下に微細化する技術の進歩により、遮断周波数が GHz 以上の CMOS も製造可 能になり、バイポーラ・トランジスタと同等レベルに向上した。作動速度が遅い p-MOSFET につ いては Si に歪を付けて高速化する技術の研究が精力的に進められている。低周波帯域で問題とな る 1/f 雑音については、MOS 電極間幅と長さを最適化設計する方法やチョッパ・アンプ等の回路 設計を工夫することで改善が図られている。

我々は二次元ガス型中性子検出器の信号読み取り及び処理する高性能 ASIC の開発を目指して いるが、このためには二次元ガス型中性子検出器からの出力パルスの周波数帯域において低雑音 且つ高 gmの MOSFET エレメントが必要である。上記のことから二種類の MOSFET エレメント MP8 と MP16 を設計し報告した。本稿では MP8 及び MP16の MOSFET の雑音を定量評価するた め、これらを用いて低雑音増幅器を構築してそれぞれの雑音指数(Noise Figure, F または NF)を計 算比較した。

2. p-MOSFET を用いた低雑音増幅器 (LNA)

2.1 LNA の構成

p-MOSFET を用いた低雑音増幅器(Low Noise Amplifier, LNA)の構成を Fig. 2.1 に示す。高周波対応の増幅器の場合には作動速度の速い n-MOSFET を用いて設計する方が現実的であるが、本稿においては二次元ガス中性子検出器システム用 ASIC に使用する MOSFET エレメントの雑音評価をするために、遇えて低周波雑音で1桁弱優位な p-MOSFET を用いた。Fig. 2.1 の LNA では p-MOSFET のソースに小さなインダクタンス L_sを挿入し、ゲート回路にインダクタンス L_gを入れていることが特徴である。Fig. 2.2 に LNA の等価回路を示す。この増幅器では L_g及び L_sを挿入することにより増幅器の入力インピーダンスを下げ、且つ信号源とのインピーダンスマッチングを図り、増幅率を MOSFET が持っている g_mの数百倍にさせ、更に周波数帯域を信号周波数に合わせて極めて狭くすることによって低雑音化を図っている。





Fig.2.2. Equivalent circuit of the LNA for calculation of input impedance Z_i .

Fig.2.1. A LNA circuit with p-MOSFETs.

2.2 LNA の入力インピーダンス

図中の v_s が電圧信号源であり、 R_s がその出力インピーダンスを表している。 L_s は MOSFET の 入力インピーダンスを信号源インピーダンスと整合させるために挿入される。ゲート回路に挿入 された L_g とソース回路の L_s の合計インダクタンスは MOSFET のゲートとソース間キャパシタン ス C_{gs} を補償するために挿入された。Fig.2.2 の $g_{ml}v_{gs}$ は MOSFET- M_1 の等価電流源である。 R_o 及 び C_o の並列回路は負荷インピーダンスである。 Z_{ai} はゲート回路 a 点から見た LNA の入力インピ ーダンスであり、式 2.1 によって表わされる。LNA の共振周波数 f_0 は式 2.2 で表わされ、 f_0 にお ける Z_{ai} は式 2.3 となる。ここで ω_T は M_1 の遮断角周波数で、MOSFET の作動の速さを表す重要な パラメータであり式 2.4 により求められる。

$$Z_{ai}(s) = s(L_s + L_g) + \frac{1}{sC_{gs}} + \left(\frac{g_{m1}}{C_{gs}}\right)L_s \quad (2.1)$$

$$\begin{split} f_0 &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{(L_s + L_g)C_{gs}}} \quad (2.2) \\ Z_{ai} &\approx \omega_T L_s \quad (at \text{ resonance}) \quad (2.3) \\ \because & \omega_T &= \frac{g_m}{c_{gs}} \quad (2.4) \end{split}$$

LNA の入力インピーダンスを信号源インピーダンスにマッチングさせた時の共振周波数 f_0 における L_s及び L_gはそれぞれ式 2.5 及び 2.6 で表わされる。

$$L_{s} = \frac{R_{s}}{\omega_{T}} \quad (\text{at resonance}) -----(2.5)$$
$$L_{g}(s_{0}) = \frac{1 - s_{0}^{2}C_{gs}R_{s}/\omega_{T}}{s_{0}^{2}C_{gs}} \quad (\text{at resonance}) -----(2.6)$$

2.3 LNA の雑音源を含めた等価回路

Fig. 2.3 に LNA の雑音源を含めた等価回路を示す。図中 R_sは信号源の出力インピーダンスの抵抗成分である。 v_{Rs} は R_sによる熱雑音を表す。 R_ℓ は L_gの抵抗成分であり、 v_ℓ は R_{\ell}による熱雑音である。R_gはゲートの Polysilicon による抵抗であり、式 2.7⁽¹⁾で表わされる。ここで R_{g1}は MOSFET 素子 1 個のゲート抵抗であり、R_□が Polysilicon のシート抵抗で Ω /sq の単位で表わされる。W とL は MOSFET 素子のゲート幅とゲート長で、n_wはボンデングワイヤの本数である。

 $R_{g1} = \frac{R_{\Box}W^{(11)}}{3n_{w}^2L}$, $R_g = \frac{R_{g1}}{a m} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}$ ------(2.7)

ここで a は MOSFET 素子のカスケード接続個数、n はパラレル接続組数であり、m がパラレル 接続段数を表している。v_{Rg}は R_gによる熱雑音である。



Fig.2.3. Equivalent circuit of the LNA for input stage noise calculations.

ω_rL_sは共振周波数における増幅器の入力インピーダンスを表している。v_{nf}はフリッカー雑音の 等価雑音源である。i_{ng}はゲート誘起雑音電流であり、g_gがその電流雑音源の等価出力アドミタン スである。また、i_{nd}はドレーン・ソース間抵抗(DS 間抵抗)による等価雑音電流で、g_{ds}がその電 流雑音源の等価出力アドミタンスである。r_dはドレーンの出力抵抗である。R_oとC_oの並列回路 は負荷インピーダンスである。

2.4 雑音指数 (Noise Figure, NF)

増幅器の雑音に対する性能の良否を表す指標として雑音指数(Noise Figure, N, NF)が用いられる。 一般に雑音指数 F と NF は使い分けられており、F は増幅器の入力における信号対雑音比と出力 における信号対雑音比の比率で表わされ、NF は F を雑音計算において扱いやすいデシベル(dB) で表わしたものである。F 及び NF の計算式を式 2.8 及び 2.9 に示す。

 $F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} = \frac{AN_i + N_o}{AN_i} = \frac{\text{Total output noise}}{\text{Total output noise due to the souce}} ------(2.8)$ $NF = 10 \text{Log}_{10} \frac{AN_i + N_o}{AN_i} ------(2.9)$

ここで、S_i及びN_iはそれぞれ増幅器入力おける信号と雑音レベルであり、S_o及びN_oはそれぞれ 増幅器出力おける信号と雑音レベルを表している。A は増幅器のゲインである。

増幅器の雑音指数 F を求めるには、Fig.2.3 に示した信号源及び増幅器に内蔵するそれぞれの雑音源によって増幅器出力端に発生するノイズパワーを計算する必要がある。

本章では Fig.2.3 の LNA 等価回路に示した信号源抵抗 R_s 、DS 間抵抗雑音電流 i_{nd} 、ゲート誘起 雑音電流 i_{ng} 、フリッカー雑音 v_{nf} 、ゲート抵抗雑音 v_{Rg} 及び Lg の抵抗雑音 R_ℓ によって増幅器出力 端に発生するそれぞれの Noise power spectral density(S_0)の計算方法について述べる。 S_0 は式 3.1 に 示すように、雑音の大きさを単位周波数当たりの二乗平均電圧又は二乗平均電流で表したもので ある。

 $S_{ov} = \frac{v_n^2}{\Delta f} \begin{bmatrix} V^2 \\ Hz \end{bmatrix}, S_{oi} = \frac{i_n^2}{\Delta f} \begin{bmatrix} A^2 \\ Hz \end{bmatrix} - \dots (3.1)$

3.1 LNA における入力ゲート回路パラメータ

LNA 出力の S_oを計算するには、入力ゲート回路のインピーダンス及びアドミタンスを調べて おくと便利である。式 2.1 に示した LNA の入力インピーダンス Z_{ai}から入力ゲート回路の総合イ ンピーダンス Z_iは式 3.2 で表わされることは容易に想像できる。

$$Z_i(s) = R_s + \omega_T L_s + s(L_s + L_g) + \frac{1}{sC_{gs}}$$
 ------(3.2)

 Z_i の抵抗成分及びリアクタンス成分をそれぞれ R_i 、 X_c 及び X_i として式 3.3、3.4 及び 3.5 で表わす。 すると Z_i は式 3.6 で表わされる。

$R_i = R_s + \omega_T L_s$	(3.3)
$X_i(s) = s(L_s + L_g) + \frac{1}{sC_{gs}}$	(3.4)
$X_{c}(s) = \frac{1}{sC_{gs}} - \dots$	
$Z_i(s) = R_i + X_i$	(3.6)

3.2 信号源抵抗による S_o

雑音指数(F)の計算では信号源抵抗 R_s による S_o が基準となる。LNA のゲート回路における信号 源抵抗雑音電圧 v_{Rs} の二乗平均値は式 3.7 で表わされる。

 $\overline{v_{Rs}^2} = 4kTR_s\Delta f \quad (3.7)$

ここで、k: ボルツマン定数 8.845 $x10^{-12}$ 、T:絶対温度、f:周波数である。この雑音によって LNA 出力に発生する $S_{o,src}$ は式 3.8 で求めることができる。下段の式は共振周波数における S_{o} である。

$$S_{o,src}(s) = 4kTR_{s}g_{m1}^{2} \left(\frac{X_{c}}{Z_{i}}\right)^{2}$$

$$= 4kTR_{s}g_{m1}^{2} \left(\frac{X_{c}}{R_{i}}\right)^{2} \quad (at resonance)$$
(3.8)

ここで g_{m1} は MOSFET-M₁のトランスコンダクタンスである。式 3.8 から LNA では M₁のトラン スコンダクタンスが見掛け上、 X_c/Z_i 倍された増幅率と等価であることがわかる。共振周波数にお いては X_c/R_i 倍である。一般に $X_c>>Z_i$ 及び $X_c>>R_i$ の関係にあるから、LNA では見掛け上の g_m を 極めて大きくすることができる。

3.3 DS 間抵抗雑音電流による S₀

DS 間抵抗雑音電流 i_{nd} は MOSFET のドレーン・ソース間の抵抗(1/g_{d0})によって発生するドレーン電流雑音である。i_{nd}の二乗平均電値は式 3.9⁽¹⁾で表わされる。

 $\overline{i_{nd}^2} = 4kT\gamma g_{d0}\Delta f$ (3.9)

ここで k:ボルツマン定数 8.845x10⁻¹²、T:絶対温度、 γ : チャンネル間距離で決まる雑音係数 2/3 $\sim 1^{(2)-(5)}$ 、ショートチャンネルでは 2 $\sim 3^{(2)}$ 、 g_{d0} : ゼロ・バイアス・ドレーン・コンダクタンス、f: 周波数である。

Fig.2.1 に示す LNA の出力端における i_{nd} による S_o を知るには、 i_{nd} 雑音が LNA によりどの程度 増幅されるかを計算する必要がある。LNA- M_1 のゲートにおける i_{nd} による等価雑音電圧は i_{nd}/g_{m1} で表わされるが、 M_1 ソース回路に挿入された L_s のフィードバック効果により、見掛け上の入力 電圧は(R_s+X_i)/ Z_i 比を掛けた大きさになる。共振周波数においてはその比は R_s/R_i である。この結 果、DS 間抵抗雑音電流によるノイズパワー i_{nda}^2 は式 3.10 のように表わされる。

 $\overline{i_{nda}^2} \approx 4kT\gamma g_{d0} \frac{R_s^2 + X_i^2}{Z_i^2} \Delta f \qquad (3.10)$ $= 4kT\gamma g_{d0} (\frac{R_s}{R_i})^2 \Delta f \qquad (at resonance)$

式 3.10 から LNA では共振周波数において DS 間抵抗雑音電流 i_{nd} は約 1/2 に低減されることがわ かった。

3.4 ゲート誘起雑音(Induced gate noise)

DS間抵抗によって発生した雑音電圧はゲートキャパシタンス Cgs を介してゲート回路にゲート誘起雑音電流 ing を誘起する。ingの発生メカニズムの詳細については参考文献⁽¹⁾で示した。ingの二乗平均値は式 3.11 で表わされる。

$$\overline{\mathbf{i}_{ng}^2} = 4kT\delta g_g \Delta f \qquad (3.11)$$
$$g_g = \frac{\omega^2 C_{g_s}^2}{\eta g_{d_0}} \qquad (3.12)$$

ここで、 δ : チャンネル間距離で決まる係数 4/3~4/15⁽⁶⁾、 ω : 角周波数、 C_{gs} : ゲート・ソース間 キャパシタンス、 g_g : ゲート等価雑音電流源のコンダクタンスであり、式 3.12 で表わされる。 η : チャンネル構造係数 1/5~1⁽⁶⁾である。 ゲート誘起雑音はその発生源が DS 間抵抗であるため、同じ発生源による DS 間熱雑音電流 ind と強い相関を持つ。式 3.13 に相関係数を含めたゲート誘起雑音の二乗平均電流値を表す式を示す。

$$\overline{i_{ng}^{2}} = 4kT\delta(1 - |c^{2}|)g_{g}\Delta f + 4kT\delta|c^{2}|g_{g}\Delta f - \dots (3.13)$$

$$c = \frac{s_{i_g,i_d}}{|s_{i_g}s_{i_d}|} \approx 0.395j \dots (3.14)$$

$$S_{i_d} = \frac{8}{3} kTg_{d0}, \ S_{i_g} = \frac{16}{15} kT \frac{(sC_{gs})^2}{g_{d0}}, \ S_{i_g.i_d} = \frac{2}{3} kT sC_{gs}$$
------(3.15)

ここで c は相関係数であり、式 3.14 は A.van der Ziel⁽⁷⁾モデルの近似式として広く用いられている。 S_{id}、S_{ig}及び S_{ig.id}は近似値としてそれぞれ式 3.15⁽⁷⁾で表わされる。式 3.13 において右辺第 1 項が 非相関の i_{ng} 電流成分で、第 2 項が相関する i_{ng} 電流成分である。

3.5 DS 間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合 S。

DS間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合S。を計算するには、相関、非相関の雑音を考慮して計算する必要がある。LNAにおいてはゲート回路にインダクタンスLgと信号源抵抗Rsが入るため、indの位相がさらにずれる。この結果、相関の度合いは式3.14のみでは決まらない。DS間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合So,ind,ingは式3.16によって計算されなければならない。

ここで、 i_{nda} は DS 間抵抗雑音によるドレーン電流、 i_{ngdcc} は c 相関係数で相関した i_{ngdc} の内、 R_s で位相がずれたあとも i_{nda} と相関するドレーン電流である。 i_{ngdcu} は c 相関係数で相関した i_{ngdc} の 内、 R_s で位相がずれたことによって i_{nda} と非相関になったドレーン電流である。 i_{ngdu} は c 相関係 数で非相関となったドレーン電流である。 i_{ng} は DS 間抵抗雑音電圧と C_{gs} の分布乗数回路により 誘起するため、その相関、非相関電流の計算は少々厄介である。以下に i_{ngdcc} 、 i_{ngdcu} 及び i_{ngdu} のそ れぞれのノイズパワーの計算方法を示し、その後 DS 間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合 So を検討する。

ingdccの二乗平均電流は式 3.17 で与えられる。

$$\overline{\mathbf{i}_{ngdcc}^{2}} = 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} |\mathbf{c}^{2}| \left(\frac{\mathbf{X}_{c}}{\mathbf{Z}_{i}}\right)^{2} \Delta \mathbf{f} \qquad (3.17)$$
$$= 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} |\mathbf{c}^{2}| \left(\frac{\mathbf{X}_{c}}{\mathbf{R}_{i}}\right)^{2} \Delta \mathbf{f} \qquad (at resonance)$$

ここで、 $4kT\gamma g_{d0}$ は DS 間抵抗雑音によるドレーン電流 i_{nd} の二乗平均電流である。 $(\delta \alpha^2)/(\eta \gamma)$ はゲート誘起雑音電流と DS 間抵抗雑音電流の二乗平均値 $4kT\gamma g_{d0}$ とを比較するための変換定数である。 c は前記した相関係数である。 (X_c/Z_i) 比は c 相関係数で相関した i_{ngdc} の内、 R_s で位相がずれたあとも尚 i_{nda} と相関する電流と i_{ngdc} との比率であり、一般に $X_c >> Z_i$ の関係にある。また、共振周波数では上記の比率は (X_c/R_i) となる。 R_i は信号源抵抗 R_s と LNA の入力インピーダンス $\omega_T L_s$ の和であり、 (X_c/R_i) 比もまた $X_c>>R_i$ の関係にある。このことから LNA では i_{ngdec} は i_{nd} に比べて 極めて大きく増幅されることを示している。

ingdeuの二乗平均電流は式 3.18 で与えられる。

$$\overline{\iota_{ngdcu}^{2}} = 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} |c^{2}| \left(\frac{R_{s}}{Z_{i}}\right)^{2} \Delta f \qquad (3.18)$$
$$= 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} |c^{2}| \left(\frac{R_{s}}{R_{i}}\right)^{2} \qquad (at resonance)$$

ここで、 $(\mathbf{R}_s/\mathbf{Z}_i)$ 比は c 相関係数で相関した i_{ngdc} の内、 \mathbf{R}_s で位相がずれたあと i_{nda} と非相関になる電流と i_{ngdc} との比率である。共振周波数では $\mathbf{Z}_i=\mathbf{R}_i$ となる結果、 $(\mathbf{R}_s/\mathbf{R}_i)=1/2$ となる。このように LNAでは i_{ngdcu} は i_{ngdcc} と比べて非常に小さい出力となることを示している。

ingduの二乗平均電流は式 3.19 で与えられる。

$$\overline{\iota_{ngdu}^{2}} = 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} (1 - |c^{2}|) \frac{R_{s}^{2} + X_{c}^{2}}{Z_{i}^{2}} \Delta f \qquad (3.19)$$
$$= 4kT\gamma g_{d0} \frac{\delta \alpha^{2}}{\eta \gamma} (1 - |c^{2}|) \frac{R_{s}^{2} + X_{c}^{2}}{R_{i}^{2}} \qquad (at resonance)$$

ここで、(1- $|c^2|$)はゲート誘起雑音電流 i_{ng} の非相関係数である。ゲートキャパシタンス C_{gs} で非相関になった i_{ng} は全量が i_{ngdu} となる。従って、式 3.17 と 3.18 から類推して増幅率(R_s+X_c)/ Z_i を容易に導くことができる。共振周波数ではその増幅率は(R_s+X_c)/ Z_i になる。これらの増幅率も非常に大きい結果、 i_{ngdu} も大きな出力となる。

上記の式 3.16 から 3.19 を用いて DS 間抵抗雑音とゲート誘起雑音による総合 S_{o,ind,ing}を求める と式 3.20 が得られる。

$$S_{o,i_{nd},i_{ng}}(s) = 4kT\gamma g_{d0} \left(\frac{R_s}{Z_i}\right)^2 \left(\left(1 + \frac{X_i}{R_s}\right)^2 + 2|c| \sqrt{\frac{\delta\alpha^2}{\eta\gamma}} \frac{X_c}{R_s} \left(1 + \frac{X_i}{R_s}\right) + \frac{\delta\alpha^2}{\eta\gamma} \left(1 + \frac{X_c^2}{R_s^2}\right) \right)$$
-------(3.20)

$$= 4kT\gamma g_{d0} \left(\frac{R_s}{R_i}\right)^2 \left(1 + 2|c| \sqrt{\frac{\delta\alpha^2}{\eta\gamma}} \frac{X_c}{R_s} + \frac{\delta\alpha^2}{\eta\gamma} \left(1 + \frac{X_c^2}{R_s^2}\right)\right) \qquad (at resonance)$$

本稿で提案した LNA は数 100MHz 以上の高周波帯域において作動させることを目的とした増幅 器であるため、その出力における S_oは式 3.20 により表わすことができる。その他の雑音源によ る S_oは無視出来るほど十分小さい。

以下に参考のため、フリッカー1/f 雑音、ゲート抵抗雑音及び Lg 抵抗雑音による So の計算法を示した。

3.6 フリッカー雑音による S₀

フリッカー雑音は 1/f 雑音とも呼ばれ、ゲート入力に発生する雑音は周波数に逆比例して増加 する。1/f 雑音電圧 v_{nf}の二乗平均値は式 3.21 で表わされる。

$$\overline{v_{nf}^2} = \frac{K_a}{C_{ox}^2 W L} \frac{1}{f^{\alpha_f}} \Delta f \quad \dots \qquad (3.21)$$

ここで K_a: フリッカー雑音係数であり p-MOS では 6.45x10⁻²⁸、n-MOS では 2.87x10⁻²⁷[C²/m²]⁽⁸⁾、 C_{ox}: ゲート酸化膜の単位面積当たりのキャパシタンス[F/m²]、W: ゲート幅[m]、L: ゲート長[m] 及びα_f: フリッカー雑音勾配係数であり p-MOS では 1.03⁽⁸⁾、n-MOS では 1.05⁽⁸⁾の 1 に近い値であ る。

フリッカー雑音はゲート入力に発生する雑音電圧であるから、これによる S_{0,1/f}は式 3.22 で表わされる。

$$S_{0,1/f}(s) = \frac{4K_F W L \omega_T^2}{9} \frac{1}{f^{\alpha} f} \left(\frac{X_c}{Z_i}\right)^2 \qquad (3.22)$$
$$= \frac{4K_F W L \omega_T^2}{9} \frac{1}{f^{\alpha} f} \left(\frac{X_c}{R_i}\right)^2 \qquad (at resonance)$$

フリッカー雑音は 1MHz 以下の低周波において問題となる雑音であり、本 LNA のように数 100 MHz 以上の周波数帯域で作動する増幅器では無視できる。

3.7 ゲート抵抗及び Lg 抵抗雑音による S_o

 L_g 抵抗及びゲート抵抗雑音による $S_{o,R\ell,Rg}$ の計算は、信号源抵抗 R_s 雑音と同様に計算されるから、 それぞれ式 3.23 で求められる。

$$S_{o,R_{\ell},R_{g}}(s) = 4kT(R_{\ell} + R_{g})g_{m1}^{2}\left(\frac{x_{c}}{z_{i}}\right)^{2} - (3.23)$$
$$= 4kT(R_{\ell} + R_{g})g_{m1}^{2}\left(\frac{x_{c}}{R_{i}}\right)^{2} \quad (at resonance)$$

ー般に MOSFET では R_{t} 、 R_{g} は信号源抵抗 R_{s} =50 Ω と比べて極めて小さいから、本 LNA ではこの 雑音も無視して差し支えない。

3.8 LNA の雑音指数(NF)

前記の 3.2 節から 3.7 節においてそれぞれの雑音源による S_oの計算式を示した。これらの計算 式を使って LNA の雑音指数(F)を求めた。抵抗雑音はホワイト雑音で全周波数帯域において雑音 レベルは一定である。ホワイト雑音が本 LNA で増幅されると極狭い共振周波数帯域で制限され る。抵抗雑音であればどの雑音も周波数帯域は同じである。従って、抵抗雑音における F の計算 は S_oの比を計算すればよい。しかし、1/f 雑音では信号源抵抗雑音と周波数特性が異なるため、 全周波数帯域で S_oを比較する必要がある。結果を式 3.24 に示す。

$$F = 1 + \frac{R_{\ell}}{R_{s}} + \frac{R_{g}}{R_{s}} + \frac{K_{a}WL\omega_{T}^{2}\int_{f}^{\frac{1}{cq_{f}}\left(\frac{X_{c}}{Z_{i}}\right)^{2}df}}{9kTR_{s}g_{m1}^{2}\int\left(\frac{X_{c}}{Z_{i}}\right)^{2}df} + \frac{\gamma}{\alpha g_{m1}}\frac{R_{s}}{X_{c}^{2}}\left(\left(1 + \frac{X_{i}}{R_{s}}\right)^{2} + 2|c|\sqrt{\frac{\delta\alpha^{2}}{\eta\gamma}}\frac{X_{c}}{R_{s}}\left(1 + \frac{X_{i}}{R_{s}}\right) + \frac{\delta\alpha^{2}}{\eta\gamma}\left(1 + \frac{X_{c}^{2}}{R_{s}^{2}}\right)\right) \dots (3.24)$$

$$F = 1 + \frac{R_{\ell}}{R_{s}} + \frac{R_{g}}{R_{s}} + \frac{K_{a}WL\omega_{T}^{2}\int_{f}^{1} \frac{(X_{c})}{R_{i}}^{2} df}{9kTR_{s}g_{m1}^{2}\int(\frac{X_{c}}{R_{i}})^{2} df} + \frac{\gamma}{\alpha g_{m1}}\frac{R_{s}}{X_{c}^{2}}\left(1 + 2|c|\sqrt{\frac{\delta\alpha^{2}}{\eta\gamma}}\frac{X_{c}}{R_{s}} + \frac{\delta\alpha^{2}}{\eta\gamma}\left(1 + \frac{X_{c}^{2}}{R_{s}^{2}}\right)\right) \quad (at resonance)$$

LNA に使用する MOSFET の R_{e} , R_{g} は信号源抵抗 R_{s} =50 Ω と比べて極めて小さいこと、及び周波数 帯域が数 100MHz の狭い帯域であることから、実用上 F は式 3.25 で表わすことができる。

$$F = 1 + \frac{\gamma}{\alpha g_{m1}} \frac{R_s}{X_c^2} \left(\left(1 + \frac{X_i}{R_s} \right)^2 + 2|c| \sqrt{\frac{\delta \alpha^2}{\eta \gamma}} \frac{X_c}{R_s} \left(1 + \frac{X_i}{R_s} \right) + \frac{\delta \alpha^2}{\eta \gamma} \left(1 + \frac{X_c^2}{R_s^2} \right) \right)$$
(3.25)
$$= 1 + \frac{\gamma}{\alpha g_{m1}} \frac{R_s}{X_c^2} \left(1 + 2|c| \sqrt{\frac{\delta \alpha^2}{\eta \gamma}} \frac{X_c}{R_s} + \frac{\delta \alpha^2}{\eta \gamma} \left(1 + \frac{X_c^2}{R_s^2} \right) \right)$$
(at resonance)

パワーの雑音指数をデシベル(dB)表示した NF は式 3.26 により表される。

$$NF = 10Log_{10}(F)$$
(3.26)

4. LNA の特性

第3章でLNA における雑音指数の計算法について述べた。この計算法を用いてLNA に我々が 提案した p-MOSFET、MP1、MP8 及び MP16 を用いた時の雑音指数を計算して比較した。MP8 及び MP16 のパターン構造を Fig.4.1 及び 4.2 に示す。特性の詳細については山岸(2010)⁽¹⁾を参照 されたい。



Fig.4.1. Schematic diagram of MP8 with high g_m consisted of 16 p-MOSFETs.



MP1 は p-MOFET 素子 1 個で構成される MOSFET である。MP8 は p-MOFET 素子 2 個をカスケー ド接続したエレメントを8組パラレル接続した MOSFET である。また、MP16 は p-MOFET 素子 2 個をカスケード接続したエレメントを8組パラレル接続したブロックを2段パラレル接続し た MOSFET である。

4.1 雑音指数評価に必要な MOSFET のパラメータ

維音指数を解析する上で重要なパラメータである g_{d0} 及び g_m 特性を Fig.4.3 及び 4.4 に示す。 g_{d0} 及び g_m が決定されれば α は g_m/g_{d0} により与えられる。MOSFET にとってもう一つの重要なパラ









メータはゲートキャパシタンス C_{gs} である。MP1、MP8 及び MP16 の C_{gs} はそれぞれ 1.88、30 及び 60fC である。NF 評価に必要な MOSFET の遮断角周波数 ω_T は式 2.4 に示した通り、 g_m / C_{gs} により求めることができる。

NF を評価するために LNA においてそれぞれの雑音源がどの程度の割合で NF に影響を与えて いるかを比較してみた。計算した雑音源はゲート抵抗 R_g 雑音、フリッカー1/f 雑音及び DS 間熱 雑音とゲート誘起電流雑音である $i_d i_g$ 雑音である。比較方法は信号源 R_s のノイズパワーとそれぞ れの雑音源のノイズパワーとの比率とした。MP8 を用い V_{gs} =-0.7V た時の計算結果を Fig.4.5 に示 す。 10⁵



Fig.4.5. Noise power ratios of MP8 compared with each noise source.

計算結果では LNA の共振周波数の関数としてそれぞれのノイズパワー比率を示したが、この 結果から 100MHz以上の共振周波数領域においては i_dig 雑音が圧倒的に大きいことを示している。 上記の計算結果から LNA における雑音指数の評価では i_dig 雑音を計算すれば十分であることが分 かった。

Fig.2.1 に示した LNA の周波数に対するゲイン特性を調べた。LNA のゲイン G_m は式 4.1 で計算 される。式 4.1 を用いて MP1、MP8 及び MP16 をそれぞれ LNA の M_1 として用いた時のゲイン特

性を計算し Fig.4.6 に示した。計算条件は共振周 波数 f₀を 200MHz に、p-MOSFET 素子 1 個当た

$$G_{\rm m}(s) = \frac{X_{\rm c}}{Z_{\rm i}} g_{\rm m1} - \dots + (4.1)$$

りのドレーン電流を 100 μ A に、信号源抵抗 R_s を 50 Ω にそれぞれ設定した。

計算結果から MP1 を用いた LNA では G_m は 大きいが作動周波数帯域が極めて狭く、0.5MHz 幅の狭い範囲でしか入力信号を増幅しない。こ れは MP1 の C_{gs} が 1.88fC と小さい結果、 Z_i の共 振周波数帯域が極めて狭くなったことに起因



Fig.4.6. G_m characteristics of the LNA compared with MP1, MP8 and MP16.

している。MP8 及び MP16 を用いた LNA においては G_m の最大値は同程度の 0.4S であった。こ れは p-MOSFET 素子 1 個当たりのドレーン電流を一定にした結果、素子数の大きい方が g_{m1} は大 きくなるが、 X_c が小さくなるためである。MP1 の傾向が異なったのは MP8 及び MP16 と MP1 と では素子パターン構造が異なったためである。MP8 及び MP16 の周波数帯域幅はそれぞれ 1.3 及 び 2.6MHz であった。このように LNA においては、共振周波数 f_0 と周波数帯域幅は MOSFET の 素子パターンにより決まるため、要求された共振周波数 f_0 と周波数帯域幅に合わせて素子パター ンを最適設計する必要がある。

4.2 雑音指数評価

式 3.24 と 3.25 を用いて LNA の共振周波数 f_0 に対する NF 特性を計算した。計算条件は信号源 抵抗 R_s を 50 Ω とし、作動条件を同一にして比較するため p-MOSFET 素子 1 個当たりのドレーン 電流を 100 μ A となるように V_{gs} を決定して計算した。上記条件における MP1、MP8 及び MP16 の C_{gs} 、 g_{d0} 、 g_m 、 α 及び ω_T は Table 4.1 に示した通りである。

Parameters MOSFETs	C _{gs} [fC]	V _{gs} [V]	g _{d0} [mS]	g _m [mS]	α	ωт
MP1	1.88	-0.51	0.22	0.20	0.90	1.1x10 ¹¹
MP8	30	-0.70	1.6	1.2	0.73	3.9x10 ¹⁰
MP16	60	-0.71	3.3	2.3	0.71	3.9x10 ¹⁰

Table 4.1. Parameters of p-MOSFETs at the condition as same drain current density.

計算結果を Fig.4.7 に示す。図は NF が共振周波数 f_0 に依存しないことを示している。これは信 号源抵抗 R_s 雑音と $i_n i_g$ 雑音が共に熱雑音源で周波数帯域が同じであるためその比を計算する NF においては周波数依存性がなくなる結果である。



Fig.4.7. NF characteristics of the LNA as a function of the resonance frequency.

式 2.8 及び 2.9 に示した定義の通り、NF は小さいほど低雑音の増幅器である。Fig.4.7 の計算結 果は MP1、MP8 及び MP16 の順に NF が低くなることを示している。即ち、LNA においては、 C_{gs} の大きな MOSFET を用い、且つ g_m を大きくして作動させることによって NF が改善されるこ とを示している。

NFの V_{gs} 依存特性について調べた。MOSFETを飽和領域で作動させる条件において、p-MOSFET の場合 V_{gs} をより小さく、n-MOSFET の場合には V_{gs} をより大きくするとドレーン電流が増加し て g_m も増大する。Fig.4.4 に示した p-MOSFET の V_{gs} 対 g_m 特性の通りである。また、 V_{gs} を大き くして作動させると Fig.4.3 のように g_{d0} も増大し、DS 間熱雑音源の抵抗が低くなり潜在的な雑 音がより小さくなることが分かる。Fig.4.8 に計算結果を示す。Fig.4.7 の結果から NF は共振周波 数に依存しないことが分かったため、この計算では共振周波数 f_0 を 200MHz に固定した。 V_{gs} を 変化させると Table 4.1 に示した MOSFET の特性パラメータは、 C_{gs} の値を除き全て V_{gs} に連動し て変化する。



Fig.4.8. NF characteristics of the LNA as a function of $V_{\rm gs}.$

Fig.4.8 の計算結果は、予想した通り V_{gs} を大きくして g_m を大きくして作動させるに従って NF が改善されることを示している。また、MP1、MP8 及び MP16 の順のように C_{gs} が大きくなるに 従って NF が改善されることも予想通りであった。NF は前記したように信号源抵抗と増幅器の S_oの比率である。雑音の大きさを定量的に理解するために信号源抵抗 R_s=50Ωが発生する雑音電 圧を示す。MP8 を使用した LNA においては 1 μ V_{ms}程度である。NF=10dB の場合、電圧比で表す と約 3 倍であるから、LNA の入力換算雑音は 2 μ V_{ms}程度となる。このことから LNA は極めて低 雑音の増幅器であることが分かる。

以上の計算結果から LNA に使用する MOSFET の Cgs を大きくすればするほど低雑音化が実現 できそうである。しかし、そう単純ではないことを断っておかなければならない。Cgs を大きく するほど MOSFET 素子数が増え、gmが比例増加しなくなり、寄生キャパシタンスも増大して遮 断周波数の低下を招き高周波作動を制限する。また、ASIC パターンが複雑になり製造歩留まり を低下させコストも上昇させるからである。従って、求める LNA 性能に最適な MOSFET パター ンにより設計することが大切である。

5. 結 論

高分解能二次元ガス中性子検出器に用いる低雑音 ASIC を開発するため、2種類の低雑音 p-MOSFET のパターン設計を行い提案した。これらの p-MOSFET の雑音を定量的に評価するため、 簡単な LNA を構成して増幅器における S₀の計算法について検討を行った。MOSFET の雑音源と しては DS 間熱雑音 i_{nd}、ゲート誘起電流雑音 i_{ng}、フリッカー雑音 v_{nf}及びゲート抵抗熱雑音 v_{Rg} 等があり、LNA においては入力インダクタンスの抵抗雑音 v_{Lg}がある。本稿ではこれらの雑音源 による S₀の計算法の検討と LNA における雑音指数の計算評価を行った。この結果、数 100MHz 以上の周波数帯域において作動させる LNA においては、v_{nf}による S₀は i_{nd} と i_{ng} との S₀と比較し て、十分小さいことが分かった。更に、DS 間熱雑音源である g_{d0}が数 mS 以下で抵抗換算すると kΩに近い値であり、これに比べて R_g と R_{Lg}の値は十分小さいことから、v_{Rg} と v_{Lg}による S₀ は無 視しても実用上差し支えないことないことが分かった。

LNA においては L_g と L_sの効果により i_{ng}が増幅されるため、LNA の S_oはその殆どが i_{ng}によっ て支配される。LNA の入力 MOSFET を MP1、MP8 及び MP16 に換えて、雑音指数を計算し比較 評価した。この結果、MP1、MP8 及び MP16 の順に雑音指数が小さくなることが分かった。これ は MP8 と MP16 の順にパラレル接続されている p-MOSFET 素子数が増加するため、見掛け上の g_{d0} がパラレル接続に比例して大きくなり、結果的に i_{nd} と i_{ng}による S_oが低下することによる。 MP1、MP8 及び MP16 を用いた夫々の LNA において、V_{gs}を大きくして作動させる程、雑音指数 が改善されることも示した。これは、V_{gs}を大きくするとドレーン電流が増加して g_mが相対的に 大きくなることに起因している。

LNA における雑音指数の計算評価により、提案した MP8 及び MP16 の p-MOSFET が高分解能 二次元ガス中性子検出器用 ASIC の低雑音増幅器に十分適応することが確認できた。

謝 辞

高速・高分解能二次元ガス型中性子検出器用 ASIC 開発研究を進めるにあたってご支援頂いた 日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 物質・生命科学研究ディビジョン 中性子基盤セ クションリーダー曽山和彦氏及び MOSFET の雑音解析法についてご指導、ご助言頂いた同中性 子基盤セクション主幹研究員の坂佐井馨氏と副主任研究員の中村龍也氏に深く感謝致します。

参考文献

- 1) 山岸秀志,他:"特定用途向け集積回路(ASIC)用MOSFETの雑音評価", JAEA-Technology 2010-030.
- A. A. Abidi,: "High-frequency noise measurements on FET's with small dimensions," IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-33, pp. 1801–1805, Nov. 1986.
- R. P. Jindal: "Hot-electron effects on channel thermal noise in fine-line NMOS field-effect transistors," IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-33, pp. 1395–1397, Sept. 1986.
- S. Tedja, J. Van der Spiegel, et al.: "Analytical and experimental studies of thermal noise in MOSFET's," IEEE Trans. Electron Devices, vol. 41, pp. 2069–2075, Nov. 1994.
- B. Wang, J. R. Hellums, et al.: "MOSFET thermal noise modeling for analog integrated circuits," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 29, pp. 833–835, July 1994.
- 6) D. Pienkowski, et al.: □A New Method of Minimizing Noise Figure of CMOS LNAs□, in ICNF 2005, Salamanca, Spain, Sept. 2005.
- 7) A.van der Ziel: "Noise in Solid State Devices and Circuits", pp.88-92 (1986).
- D. M. Binkley, et al.: "Noise Performance of 0.35-μm SOI CMOS Devices and Micropower Preamplifier from 77-400 K",16 2004 IEEE AeroConf.2003.

表2. 基本単位を用いて表されるSI組立単位の例 表1. SI 基本単位

甘木県	SI 基本ì	単位
基个里	名称	記号
長さ	メートル	m
質 量	キログラム	kg
時 間	秒	s
電 流	アンペア	Α
熱力学温度	ケルビン	Κ
物質量	モル	mol
光 度	カンデラ	cd

	100			
组立量		SI 基本単位		
和立里		名称	記号	
面	積	平方メートル	m ²	
体	積五	立法メートル	m ³	
速さ,速	度 >	メートル毎秒	m/s	
加速	度 >	メートル毎秒毎秒	m/s^2	
波	数每	毎メートル	m ⁻¹	
密度,質量密	度 =	キログラム毎立方メートル	kg/m ³	
面 積 密	度	キログラム毎平方メートル	kg/m ²	
比 体	積ゴ	立方メートル毎キログラム	m ³ /kg	
電流密	度フ	アンペア毎平方メートル	A/m^2	
磁界の強	さフ	アンペア毎メートル	A/m	
量濃度 ^(a) ,濃	度刊	モル毎立方メートル	mol/m ³	

第一の「濃度」での「海」で「シートル」 mol/m³ 量濃度にの、濃度モル毎立方メートル mol/m³ 量濃度キログラム毎立法メートル g^{\dagger} かンデラ毎平方メートル cd/m^2 折率(b^{\dagger} (数字の) 1 1 透磁率(b^{\dagger} (数字の) 1 1 質 輝 屈 透磁 比

(a) 量濃度 (amount concentration) は臨床化学の分野では物質濃度 (substance concentration) ともよばれる。
 (b) これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるが、そのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない。

表3. 固有の名称と記号で表されるSI組立単位

	SI 組立単位				
組立量	名称	記号	他のSI単位による 表し方	SI基本単位による 表し方	
平 面 角	ヨラジアン ^(b)	rad	1 ^(b)	m/m	
立 体 牟	コテラジアン ^(b)	$sr^{(c)}$	1 ^(b)	m ² /m ²	
周 波 数	ベルツ ^(d)	Hz		s ⁻¹	
力	ニュートン	Ν		m kg s ^{'2}	
圧力,応力	パスカル	Pa	N/m ²	m ⁻¹ kg s ⁻²	
エネルギー,仕事,熱量	ビュール	J	N m	m ² kg s ⁻²	
仕事率, 工率, 放射束	モワット	W	J/s	$m^2 kg s^{\cdot 3}$	
電荷,電気量	ローロン	С		s A	
電位差(電圧),起電力	ボルト	V	W/A	m ² kg s ⁻³ A ⁻¹	
静電容量	マアラド	F	C/V	$m^{2} kg^{1} s^{4} A^{2}$	
電気抵抗	ī オーム	Ω	V/A	$m^2 kg s^{\cdot 3} A^{\cdot 2}$	
コンダクタンフ	ジーメンス	S	A/V	$m^{-2} kg^{-1} s^3 A^2$	
磁芽	ミウエーバ	Wb	Vs	$m^2 kg s^2 A^1$	
磁束密度	テスラ	Т	Wb/m ²	kg s ⁻² A ⁻¹	
インダクタンフ	、ヘンリー	Н	Wb/A	$m^2 kg s^2 A^2$	
セルシウス温度	モルシウス度 ^(e)	°C		K	
光 東	モルーメン	lm	cd sr ^(c)	cd	
照度	レクス	lx	lm/m^2	m ⁻² cd	
放射性核種の放射能 ^(f)	ベクレル ^(d)	Bq		s ⁻¹	
吸収線量,比エネルギー分与,	グレイ	Gv	J/kg	m ² s ⁻²	
カーマ		сл <i>у</i>	0/11g	111 5	
線量当量,周辺線量当量,方向 性線量当量,個人線量当量,	シーベルト (g)	Sv	J/kg	$m^2 s^2$	
酸 素 活 相	カタール	kat		s ⁻¹ mol	
				U 11101	

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない。
 (b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。 実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない。
 (o)剤光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
 (d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
 (e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス選びを大しに使用される。セルシウス度とケルビンの 単位の大きさは同一である。したかって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
 (f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)は、しばしば認った用語で"radioactivity"と記される。
 (g)単位シーベルト(PV,2002,70,205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照。

表4. 単位の	中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

	SI 組立単位			
組立量	名称	SI 基本単位による 表し方		
粘度	パスカル秒	Pa s	m ⁻¹ kg s ⁻¹	
カのモーメント	ニュートンメートル	N m	m ² kg s ⁻²	
表 面 張 九	ニュートン毎メートル	N/m	kg s ⁻²	
角 速 度	ラジアン毎秒	rad/s	m m ⁻¹ s ⁻¹ =s ⁻¹	
角 加 速 度	ラジアン毎秒毎秒	rad/s^2	m m ⁻¹ s ⁻² =s ⁻²	
熱流密度,放射照度	ワット毎平方メートル	W/m^2	kg s ^{'3}	
熱容量、エントロピー	ジュール毎ケルビン	J/K	$m^2 kg s^{-2} K^{-1}$	
比熱容量, 比エントロピー	ジュール毎キログラム毎ケルビン	J/(kg K)	$m^2 s^{-2} K^{-1}$	
比エネルギー	ジュール毎キログラム	J/kg	$m^{2} s^{2}$	
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン	W/(m K)	m kg s ⁻³ K ⁻¹	
体積エネルギー	ジュール毎立方メートル	J/m ³	m ⁻¹ kg s ⁻²	
電界の強さ	ボルト毎メートル	V/m	m kg s ⁻³ A ⁻¹	
電 荷 密 度	クーロン毎立方メートル	C/m ³	m ⁻³ sA	
表 面 電 荷	クーロン毎平方メートル	C/m^2	m ⁻² sA	
電束密度, 電気変位	クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ⁻² sA	
誘 電 卒	ファラド毎メートル	F/m	$m^{-3} kg^{-1} s^4 A^2$	
透磁 卒	ヘンリー毎メートル	H/m	m kg s ⁻² A ⁻²	
モルエネルギー	ジュール毎モル	J/mol	$m^2 kg s^2 mol^1$	
モルエントロピー, モル熱容量	ジュール毎モル毎ケルビン	J/(mol K)	$m^{2} kg s^{2} K^{1} mol^{1}$	
照射線量 (X線及びγ線)	クーロン毎キログラム	C/kg	kg ⁻¹ sA	
吸収線量率	グレイ毎秒	Gy/s	$m^2 s^{-3}$	
放 射 強 度	ワット毎ステラジアン	W/sr	$m^4 m^{2} kg s^{3} = m^2 kg s^{3}$	
放射輝度	ワット毎平方メートル毎ステラジアン	$W/(m^2 sr)$	m ² m ⁻² kg s ⁻³ =kg s ⁻³	
酵素活性濃度	カタール毎立方メートル	kat/m ³	$m^{3} s^{1} mol$	

表 5. SI 接頭語							
乗数	接頭語	記号	乗数	接頭語	記号		
10^{24}	ヨ タ	Y	10^{-1}	デシ	d		
10^{21}	ゼタ	Z	$10^{.2}$	センチ	с		
10^{18}	エクサ	Е	10^{-3}	ミリ	m		
10^{15}	ペタ	Р	10^{-6}	マイクロ	μ		
10^{12}	テラ	Т	10^{-9}	ナノ	n		
10^{9}	ギガ	G	$10^{\cdot 12}$	ピョ	р		
10^{6}	メガ	М	$10^{.15}$	フェムト	f		
10^{3}	キロ	k	$10^{\cdot 18}$	アト	а		
10^{2}	ヘクト	h	$10^{.21}$	ゼプト	z		
10^{1}	デ カ	da	10^{-24}	ヨクト	У		

表6. SIに属さないが、SIと併用される単位				
名称	記号	SI 単位による値		
分	min	1 min=60s		
時	h	1h =60 min=3600 s		
日	d	1 d=24 h=86 400 s		
度	۰	1°=(п/180) rad		
分	,	1'=(1/60)°=(п/10800) rad		
秒	"	1"=(1/60)'=(п/648000) rad		
ヘクタール	ha	1ha=1hm ² =10 ⁴ m ²		
リットル	L, l	1L=11=1dm ³ =10 ³ cm ³ =10 ⁻³ m ³		
トン	t	$1t=10^3 \text{ kg}$		

表7. SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で

表される数値が実験的に得られるもの						
名称				記号	SI 単位で表される数値	
電	子 オ	、ル	Ч	eV	1eV=1.602 176 53(14)×10 ⁻¹⁹ J	
ダ	ル	ŀ	\sim	Da	1Da=1.660 538 86(28)×10 ⁻²⁷ kg	
統-	一原子	質量単	〔位	u	1u=1 Da	
天	文	単	位	ua	1ua=1.495 978 706 91(6)×10 ¹¹ m	

表8.SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位						
	名称		記号	SI 単位で表される数値		
バ	_	ル	bar	1 bar=0.1MPa=100kPa=10 ⁵ Pa		
水銀	柱ミリメー	トル	mmHg	1mmHg=133.322Pa		
オン	グストロ・	- 4	Å	1 Å=0.1nm=100pm=10 ⁻¹⁰ m		
海		里	М	1 M=1852m		
バ		\sim	b	1 b=100fm ² =(10 ⁻¹² cm)2=10 ⁻²⁸ m ²		
1	ツ	ŀ	kn	1 kn=(1852/3600)m/s		
ネ		パ	Np	ロ光伝しの粉はめた眼接は		
ベ		ル	В	51単位との数値的な関係は、 対数量の定義に依存。		
デ	ジベ	ル	dB -	X19X ± 17 AC44 (* [X1])		

表9. 固有の名称をもつCGS組立単位						
名称	記号	SI 単位で表される数値				
エルク	erg	1 erg=10 ⁻⁷ J				
ダイン	dyn	1 dyn=10 ⁻⁵ N				
ポアフ	P	1 P=1 dyn s cm ⁻² =0.1Pa s				
ストークフ	St	$1 \text{ St} = 1 \text{ cm}^2 \text{ s}^{\cdot 1} = 10^{\cdot 4} \text{m}^2 \text{ s}^{\cdot 1}$				
スチルフ	sb	$1 \text{ sb} = 1 \text{ cd} \text{ cm}^{2} = 10^{4} \text{ cd} \text{ m}^{2}$				
フォト	ph	1 ph=1cd sr cm 2 10 ⁴ lx				
ガル	Gal	$1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm s}^{-2} = 10^{-2} \text{ ms}^{-2}$				
マクスウェル	Mx	$1 \text{ Mx} = 1 \text{G cm}^2 = 10^{-8} \text{Wb}$				
ガウジ	G	$1 \text{ G} = 1 \text{Mx cm}^{-2} = 10^{-4} \text{T}$				
エルステッド ^(c)	Oe	1 Oe ≙ (10 ³ /4π)A m ⁻¹				
(。) 2 元 조のCCC単位 조 しCIでけ 古 接 比較 で き わい た め 年 年 「 △						

3元系のCGS単位系とSI Cは は対応関係を示すものである。

表10. SIに属さないその他の単位の例						
名称					記号	SI 単位で表される数値
キ	ユ		IJ	ĺ	Ci	1 Ci=3.7×10 ¹⁰ Bq
ν	\sim	ŀ	ゲ	\sim	R	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{C/kg}$
ラ				ĸ	rad	1 rad=1cGy=10 ⁻² Gy
ν				Д	rem	1 rem=1 cSv=10 ⁻² Sv
ガ		$\boldsymbol{\nu}$		7	γ	1 γ =1 nT=10-9T
フ	r		ル	i.		1フェルミ=1 fm=10-15m
メー	ートル	系	カラッ	ット		1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ŀ				ル	Torr	1 Torr = (101 325/760) Pa
標	準	大	気	圧	atm	1 atm = 101 325 Pa
力	Ц		IJ	_	cal	1cal=4.1858J(「15℃」カロリー), 4.1868J (「IT」カロリー) 4.184J(「熱化学」カロリー)
ŝ	ク			\sim	μ	$1 \mu = 1 \mu m = 10^{-6} m$

この印刷物は再生紙を使用しています